

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **63-157439**

(43)Date of publication of application : **30.06.1988**

(51)Int.Cl.

H01L 21/88

(21)Application number : **61-304454**

(71)Applicant : **FUJITSU LTD**

(22)Date of filing : **20.12.1986**

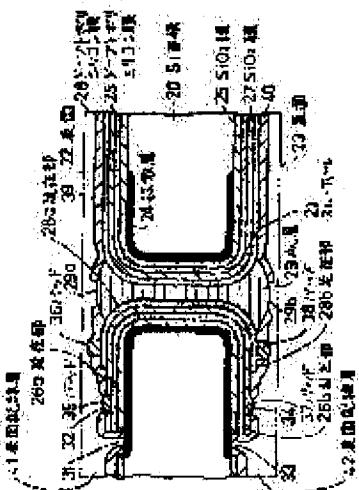
(72)Inventor : **HASEGAWA HITOSHI**

(54) MULTILAYER INTERCONNECTION STRUCTURE IN THROUGH HOLE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the number of necessary through holes, eliminate the limitation of a through hole diameter, and manufacture excellently a multilayer interconnection structure, by applying a multilayer structure to the wiring of through holes.

CONSTITUTION: Wiring in the through hole 21 of a P-Si substrate 20 is formed as a multilayer structure wherein the respective wiring layers 24, 26 and 28 are stacked via the respective insulative layers 24, 26 and 28. On extending parts 26a, 26b, 28a and 28b to a rear surface 23, connection parts 35W38 to other wirings are formed so as to reach the surface 22 of the multilayer interconnections 24, 26 and 28. The wiring of through hole 21 is formed as a multilayer structure, and the number of necessary through holes 21 is reduced. Thereby the limitation of the diameter of through hole 21 is eliminated, and the multilayer interconnection structure is excellently manufactured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑪ 公開特許公報 (A) 昭63-157439

⑫ Int.Cl.⁴

H 01 L 21/88

識別記号

厅内整理番号

⑬ 公開 昭和63年(1988)6月30日

J - 6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑤発明の名称 スルーホール内の多層配線構造

⑥特 願 昭61-304454

⑦出 願 昭61(1986)12月20日

⑧発明者 長谷川 齊 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社
内

⑨出願人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

⑩代理人 弁理士 井桁 貞一

明細書

1. 発明の名称

スルーホール内の多層配線構造

(産業上の利用分野)

本発明はスルーホールの内の多層配線構造に関する。

2. 特許請求範囲

基板(20)のスルーホール(21)内の配線を複数の配線層(24, 26, 28)の夫々が絶縁層(25, 27)を介して積層された多層構造とし、且つ上記各配線層の上記基板の表面(22)及び裏面(23)上への延在部(26a, 26b, 28a, 28b)に、他の配線との接続部(35~38)を設けてなるスルーホール内の多層配線構造。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

本発明はスルーホール内の多層配線構造において、スルーホール内の配線を多層構造として、スルーホールの数を少なくすること及び基板表面の微細配線を可能としたものである。

(従来の技術)

本発明者は先に、第4図に示すように、半導体マザーチップ1上に複数の半導体ディバイスチップ2, 3, 4を積層してなる構造の半導体装置を提案した。この半導体ディバイスチップ2(3, 4)は、この上側に積層された半導体ディバイスチップとこの下側の半導体ディバイスチップとの間の電気的接続をとるため及び半導体ディバイスチップ自体内の半導体ディバイス部との電気的接続をとるため、内部配線を有している。内部配線は基板のスルーホール一個所につき一配線である。第1図中、6, 7, 8はスルーホール、9, 10, 11は夫々スルーホール6, 7, 8内の一周構造の内部配線である。

〔発明が解決しようとする問題点〕

このため、半導体ディバイスチップ2(3,4)には、上記の電気的接続に必要とされる数と同数のスルーホールを形成することになる。このスルーホールは例えばエッチングにより形成される。こゝで特に半導体ディバイスチップの基板が400~500μと厚い場合には、スルーホールの径を小とし、隣り合うスルーホールの間の間隔を狭くすることが特に困難となる。

このように、スルーホールの数が多いこと、及びスルーホールの間隔が広いことにより、半導体ディバイスチップ2(3,4)の表面の配線を微細化することが出来ないという問題点があった。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明のスルーホール内の多層配線構造は、基板のスルーホール内の配線を複数の配線層の夫々が絶縁層を介して積層された多層構造とし、且つ上記各配線層の上配基板の表面及び裏面上への延在部に、他の配線との接続部を設けてなる。

を例えばエッチングにより形成する。配線を多層構造とする關係で、スルーホール21の数は少なくてよく、例えば一つでもよく、またスルーホール21の径dは大きくてもよく、スルーホール21は容易に形成される。なお、基板20には半導体ディバイス部(図示せず)が形成されている。

次に、第2図(B)に示すように、スルーホール21の内周面及び基板20の表面22及び裏面23のうちスルーホール21の開口近傍部にn+拡散層24を形成する。これが第1配線層を構成する。

次いで、熱酸化を行って、第2図(C)に示すように、第1絶縁層としてのSiO₂膜25を、スルーホール21の内周面及び基板20の裏面をカバーするように形成する。

次いで、CVDを行なって、第2図(D)に示すように、SiO₂膜25上にドープトポリシリコンを被着させ、第2配線層としてのドープトポリシリコン膜26を、スルーホール21の内周面及び基板20の裏面に形成する。

〔作用〕

スルーホール内の配線を多層構造としたことにより、スルーホールについては必要とされる数が減り、径についての制限も緩和され、スルーホールが形成し易くなる。

各配線層の基板の裏面に於ける延在部に他の配線との接続部を設けたことにより、接続部を密接して配することが可能となり、裏面の配線層の微細化が可能となる。

〔実施例〕

第1図は本発明のスルーホール内の多層配線構造の一実施例を示し、第2図(A)乃至(G)は多層配線構造の製造工程を示し、第3図は第1図のスルーホール内の多層配線構造を適用した半導体ディバイスチップ(半導体装置)を示す。

第1図の多層配線構造を、その製造工程に沿って説明する。

まず、第2図(A)に示すように厚さが300~500μのP-Si基板20にスルーホール21

次いで、熱酸化を行なって、上記膜26の表面全体に、即ちスルーホール内周面及び基板の上下面に、第2図(E)に示すように、第2絶縁層としてのSiO₂膜27を形成する。これにより、ドープトポリシリコン膜26が上下よりSiO₂膜25, 27により挟まれた状態となる。

次いで、再びCVDを行なって、第2図(F)に示すように、SiO₂膜27上にドープトポリシリコンを被着させ、第3配線層としてのドープトポリシリコン膜28を、スルーホール21の内周面及び基板の裏面に形成する。

こゝで、膜形成方法として、拡散、熱酸化及びCVDを用いているため、第2図(A)に示すようにスルーホール21の長さl(基板20の厚さtに等しい)が長くとも、前記の拡散層24及び膜25~28は共にスルーホール21の内周面にも確実に形成される。

次いで第2図(G)に示すように、スルーホールの部分をAu(又はPb/Sn)によりメッキし、最終配線層としてのAu層29を形成する。

次に、第1図に示すように、基板の表面22及び裏面23のうちスルーホール21の端口の近傍の所定の箇所を選択的にエッチングしてコンタクトホール31～34を形成し、接続部としてのパッド35～38を形成し、パッド35～38及びAリ層29の上下端部29a, 29bを除いて、PSG膜の絶縁層39, 40を形成する。

パッド35, 36は夫タドープトポリシリコン膜26, 28の基板表面22側への延在部26a, 28aに設けてある。別のパッド37, 38は夫タドープトポリシリコン膜26, 28の基板裏面23側への延在部26b, 28bに設けてある。

基板20の表面のパッド35と裏面のパッド37とがドープトポリシリコン膜26により結線されている。パッド36とパッド38とは、別のドープトポリシリコン膜28により結線されている。上端部29aと下端部29bとは、スルーホール21内のAリ層29自体により電気的に接続されている。

更には、第1図中、二点綴線で示すように、基

る。

この半導体ディバイスチップ50は、第3層に示すように半導体マザーチップ51上にバンプ52, 53を利用して突張される。更にチップ50と略同じ構造の半導体ディバイスチップ54, 55がチップ50上に積層して実装され、三層構造の半導体装置56が得られる。

なお、第2図(C), (E)に示す熱酸化によるSiO₂膜27の代りに、CVDによるSi_xN_y膜としてもよい。また、第2図(D), (F)に示すドープトポリシリコン膜26, 28の代わりに、CVDによるタンクステンシリサイドなどのシリサイド膜としてもよい。またAリ層29の代わりにPb/Sn層としてもよく、この場合にはリフローにより平坦化を行なってもよい。

(発明の効果)

本発明によれば、スルーホール内の配線が多層構造であるため、従来の様に単層構造である場合

板20の表面22側に表面配線41をその一端がパッド35, 36及び端部29a等と接続され、他端が基板20上の半導体ディバイス部(図示せず)と接続されるようにして形成する。表面配線41の一部の他端にはチップ積層用のバンプ(図示せず)が形成される。同じく、基板20の裏面23側にも、裏面配線42をその一端がパッド37, 38及び端部29b等と接続されるようにして形成する。他端にはチップ積層用のバンプ(図示せず)が形成される。

ここで、パッド35～38、上下端部29a, 29bは比較的自由度をもって近接して配されており、表面配線41及び裏面配線42は共に微細に形成される。

特にパッド35～38についてみると、これが接続される相手との間隔で接続がし易い位置に配することが出来、表面配線41及び裏面配線42をバーニングがし易い構造とし得る。

以上により、内部配線を多層構造としてなる第3図中一の半導体ディバイスチップ50が得られ

に比べて、スルーホールの数を少なくすることが出来、スルーホールの径の制限が緩和され、スルーホールを容易に形成することが出来、しかしあ複数の接続部が近接して配されるため、表面に微細な配線を形成することが出来、例えば多層に積重して実装される半導体ディバイスチップに適用して有効である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明のスルーホール内の多層配線構造の一実施例を示す図。

第2図(A)乃至(G)はスルーホール内の多層配線構造の製造工程を示す図。

第3図は第1図のスルーホール内の多層配線構造を内部配線として適用してなる半導体装置を示す図。

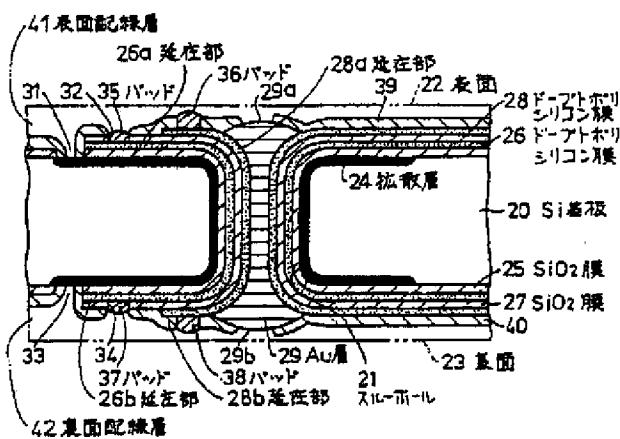
第4図は内部配線が單層構造である半導体装置を示す図である。

図において、

20はp-Si基板、

21はスルーホール、

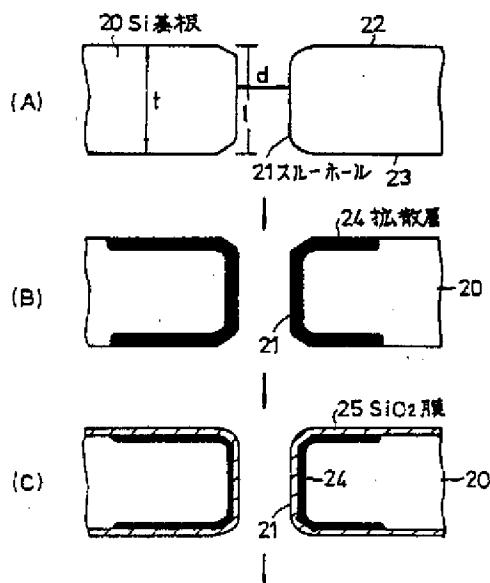
22は表面、
23は裏面、
24は凹・拡散層、
25, 27はSiO₂膜、
26, 28はドープトボリシリコン膜、
26a, 26b, 28a, 28bは延在部、
29はAu層、
31~34はコンタクトホール、
35~38はパッド、
39, 40は絶縁層、
41は表面配線層、
42は裏面配線層、
50, 54, 55は半導体ディバイスチップ、
56は半導体装置である。



本発明のスルーホール内の多層配線構造の一実施例を示す図

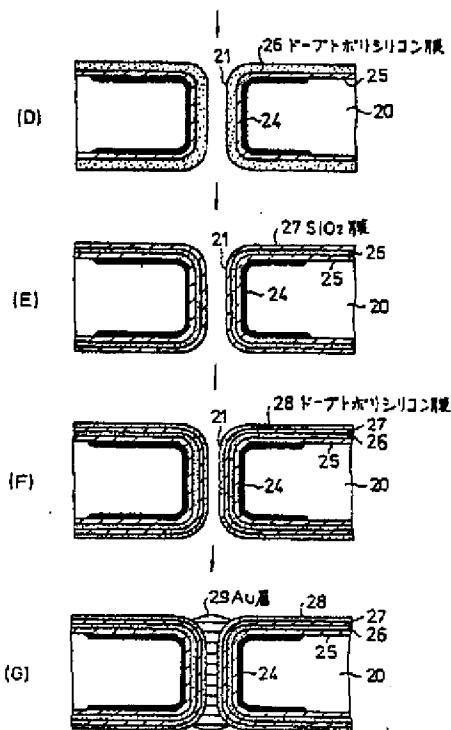
第1図

代理人弁理士井桁貞



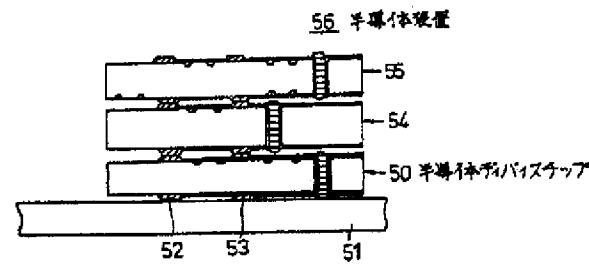
スルーホール内に多層配線を形成する工程を説明する図

第2図(1)



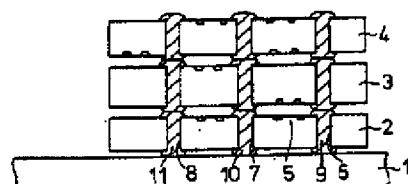
スルーホール内に多層配線を形成する工程を説明する図

第2図(2)



本発明の多層配線構造を適用してなる
半導体装置を示す図

第3図



内部配線が单層構造である
半導体装置を示す図

第4図